

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



INTERNATIONAL BUREAU OF INDUSTRIAL PROPERTY
15, rue des Capucines, 75001 PARIS, FRANCE
TEL: (33) 1 47 37 60 00 FAX: (33) 1 47 37 60 01
E-MAIL: ipo@wipo.int WWW: www.wipo.int

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
28. Juli 2005 (28.07.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/069703 A2

(51) Internationale Patentklassifikation: H05H 1/46,
H01J 37/32

(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LAURE, Stefan
[DE/DE]; Schwanenstr. 12, 70329 Stuttgart (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2005/000047

(22) Internationales Anmeldedatum:
14. Januar 2005 (14.01.2005)

(74) Anwalt: LUCHT, Silvia; Werderring 15, 79098 Freiburg
(DE).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2004 002 878.8 15. Januar 2004 (15.01.2004) DE

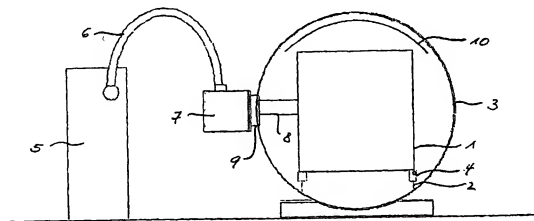
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): DR. LAURE PLASMA TECHNOLOGIE GMBH
[DE/DE]; Schwanenstr. 12, 70329 Stuttgart (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, I.K. LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: PLASMA TREATMENT OF LARGE-SCALE COMPONENTS

(54) Bezeichnung: PLASMA BEHANDLUNG GROSSVOLUMIGER BAUTEILE



(57) Abstract: The invention relates to a device and a method for the plasma treatment of large-scale components. Said device comprises a vacuum chamber (3) containing one or more pumps, a transport device (2) for conveying the component (1) into the vacuum chamber (3), insulation (4) that is situated between the component (1) and the vacuum chamber (3), a resonant circuit comprising a high-frequency generator (5), an adjustable capacitance and an adjustable inductance of the resonant circuit and at least one connection for connecting the resonant circuit to the component (1). To carry out said method, the component (1) is placed in the vacuum chamber (3), the latter is evacuated, the component (1) is connected to the resonant circuit comprising the high-frequency generator (5) and the inductance and/or the capacitance of the resonant circuit is tuned to the component (1).

(57) Zusammenfassung: Es werden eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Plasmaabehandlung grossvolumiger Bauteile vorgeschlagen. Die Vorrichtung weist eine Vakuumkammer (3) mit einer oder mehreren Pumpen, eine Transportvorrichtung (2) zum Befördern des Bauteils (1) in die Vakuumkammer (3), eine Isolation (4) zwischen dem Bauteil (1) und der Vakuumkammer (3), einen Schwingkreis mit einem Hochfrequenzgenerator (5), eine einstellbare Kapazität und eine einstellbare Induktivität des Schwingkreises und mindestens einen Anschluss zum Verbinden des Schwingkreises mit dem Bauteil

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]